UPDATE Small spot < 10 µm

EnviroMETROS LAB

MULTIMODAL SURFACE AND INFERFACE CHARACTERIZATION
FOR ADVANCED MATERIALS RESEARCH

KEY FEATURES

- Non-destructive depth profiling via PARXPS and HAXPES
- Four X-ray lines Al, Ag, Ti and Cr
- < 10 µm X-ray spot size
- Near-ambient pressure optional
- Additional techniques: UPS, IPES, REELS, SEM/SAM, RAMAN/IRRAS



Enviro™
A member of SPECSGROUP

東京インスツルメンツ
TOKYO INSTRUMENTS
グローバルにネットワークを広げ、最先端の科学をお客様に提供

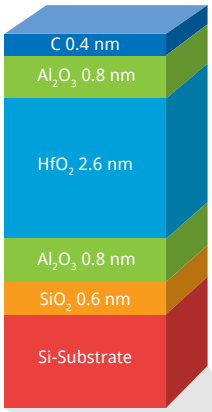
本　社：〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6-18-14 T. I.ビル　Tel. 03-3686-4711
営業所：〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-46 新大阪北ビル　Tel. 06-6393-7411
URL：https://www.tokyoinst.co.jp　Mail：sales@tokyoinst.co.jp

TII Group Company
UNISOKU TII Group 超高真空・極低温走査型プローブ顕微鏡 高速分光測定装置、クライオスタット
LOTIS TII Nd:YAGレーザー、Ti:Sレーザー OPOレーザー

UPDATE Small spot < 10 µm

EnviroMETROS FAB

FULL WAFER, NON-DESTRUCTIVE DEPTH PROFILING FOR THIN FILMS, MULTILAYERS AND ADVANCED DEVICES



KEY FEATURES

- Non-destructive depth profiling up to 30 nm
- Material-specific spectral response
- Nanoscale thickness accuracy
- Interface and transition detection
- Multilayer reconstruction



Enviro™

A member of SPECSGROUP

東京インスツルメンツ
TOKYO INSTRUMENTS
グローバルにネットワークを広げ、最先端の科学をお客様に提供

本　社：〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6-18-14 T. I.ビル　Tel. 03-3686-4711
営業所：〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-46 新大阪北ビル　Tel. 06-6393-7411
URL：https://www.tokyoinst.co.jp　Mail：sales@tokyoinst.co.jp

TII Group Company

UNISOKU TII Group
超高真空・極低温走査型プローブ顕微鏡
高速分光測定装置、クライオスタット

LOTIS TII
Nd:YAGレーザー、Ti:Sレーザー
OPOレーザー